

成膜 (CVD、スパッタ、蒸着他)



LP-CVD

システムサービス
SiN、Poly-Si、NSG



減圧熱CVD

国際電気
Epi-Poly Si、1200°C



PE-CVD

日本生産技術 VDS-5600
SiN、SiO₂



PE-CVD

住友精密 MPX-CVD
SiN、SiO₂



W-CVD

アプライドマテリアルズ
Precision 5000



スパッタ装置

アネルバ SPF-730
5インチターゲット×3



スパッタ装置

芝浦メカトロニクス CFS-4ESII
3インチターゲット×3
基板加熱形1台、基板冷却形1台



電子ビーム蒸着装置

アネルバ EVC-1501

成膜 (CVD、スパッタ、蒸着他)



ゾルゲル自動成膜装置

テクノファイン PZ-604



めっき装置

山本鍍金試験器